Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018361

International filing date: 09 December 2004 (09.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-411442

Filing date: 10 December 2003 (10.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



玉 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年12月10日

願 出 番 Application Number:

特願2003-411442

[ST. 10/C]:

[JP2003-411442]

出 願 Applicant(s):

松下電器産業株式会社

特許庁長官 Japan Patent Office

Commissioner,

2005年 1月27日





1/E

特許願 【書類名】 2032450307 【整理番号】 平成15年12月10日 【提出日】 【あて先】 特許庁長官殿 G02F 1/37 【国際特許分類】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 【住所又は居所】 杉田 知也 【氏名】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 水内 公典 【氏名】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 笠澄 研一 【氏名】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 森川 顕洋 【特許出願人】 000005821 【識別番号】 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社 【代理人】 100097445 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 岩橋 文雄 【選任した代理人】 【識別番号】 100103355 【弁理士】 坂口 智康 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 【識別番号】 100109667 【弁理士】 内藤 浩樹 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 011305 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

複数の導波管と、前記導波管を直列に光学的に結合する光路変換手段とを具備し、前記導波管の任意の一端面に入射された光が前記導波管および前記光路変換手段を伝搬し、前記入射面と異なる出射面から出力されることを特徴とする光学素子。

【請求項2】

前記導波管の数が奇数個であり、かつ光の伝搬方向と平行な前記導波管側面で隣り合う導 波管と積層されていることを特徴とする請求項1に記載の光学素子。

【請求項3】

前記光路変換手段が、前記導波管の一部を加工することにより形成されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の光学素子。

【請求項4】

前記導波管の光入出射面以外の面が、伝搬する光に対して高反射コートされていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の光学素子。

【請求項5】

前記導波管が中空構造のセルであり、かつ前記中空部内に気体または液体のいずれかと、 ブラウン粒子が封入されていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載 の光学素子。

【請求項6】

前記ブラウン粒子がコロイド粒子であることを特徴とする請求項5に記載の光学素子。

【請求項7】

前記光路変換手段を含む前記導波管の光入射端面から光出射端面までの光路長Lが、前記導波管の幅をW、前記導波管内部の屈折率をn、前記光導波路に入射される直前の光の有する最小のビーム広がり角度を θ とした場合に、 $L \ge W/t$ an (sin 1 (sin ($\theta/2$)/n)) であることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の光学素子。

【請求項8】

請求項1から請求項7のいずれかに記載の光学素子と、半導体レーザとを具備し、前記半 導体レーザからの出射光を前記光学素子の一端面から入射させ、前記光学素子の別の端面 から出射させることを特徴とするレーザ光源。

【請求項9】

前記構成に加え、シリンドリカルレンズを具備し、前記半導体レーザと前記光学素子との 光路内に前記シリンドリカルレンズが配置されていることを特徴とする請求項8に記載の レーザ光源。

【請求項10】

前記シリンドリカルレンズが、平凹レンズであることを特徴とする請求項9に記載のレー ザ光源。

【請求項11】

前記構成に加え、凸レンズもしくは平凸レンズのいずれかを具備し、前記半導体レーザと 前記光学素子との光路内に前記凸レンズもしくは前記平凸レンズのいずれかが配置されて いることを特徴とする請求項8に記載のレーザ光源。

【請求項12】

前記光学素子のレーザ光入射端面が、曲率を有する形状に加工されていることを特徴とする請求項8に記載のレーザ光源。

【請求項13】

少なくとも請求項8から請求項12のいずれかに記載のレーザ光源と、空間光変調手段と を具備し、前記レーザ光源からの光を前記空間光変調手段に照明する照明光学系を有する ことを特徴とする2次元画像形成装置。

【請求項14】

前記構成に加え、投射光学系を具備し、前記空間光変調手段からの出力光を前記投射光学

系により投射することを特徴とする請求項13に記載の2次元画像形成装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】光学素子およびレーザ光源および2次元画像形成装置 【技術分野】

[0001]

本発明は、入射する光を、均一な断面光強度分布を有する出射光に変換する光学素子に関するものである。また、上記光学素子と半導体レーザを一体化したレーザ光源に関するものである。また上記レーザ光源を用いた2次元画像形成装置に関するものである。

【背景技術】

[0002]

高出力光源は、半導体露光装置や画像表示装置、照明装置など幅広い用途があり、研究開発が進められている。特に高出力レーザを用いた光源はその単色性を生かして、例えばRGB三原色の高出力レーザを用いたレーザディスプレイによる高色純度鮮明画像への応用が模索されている。また、レーザ加工による微細形状加工も実用化されつつある。また、小型で高出力のレーザ光源は低消費電力かつ長寿命な照明用光源としての実現が期待されている。

【特許文献1】特開平07-306304号公報

【特許文献2】特許第3410813号公報

【特許文献3】特開2002-40327号公報

【特許文献4】特開2003-57514号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

しかしながら、これら高出力レーザ光源を用いたアプリケーションには均一強度分布に対する要求が大きく、従来方法では、例えば特許文献1や特許文献2に示されるようなホモジナイザと呼ばれる光量均一化デバイスや光学系、あるいは特許文献3や特許文献4のようなインテグレータと呼ばれる光学デバイスを用いて、レーザから発振するガウシアン強度分布を成形していたが、上記デバイスや光学系に入射する光断面積を適当に拡げておく必要があるため、光源を含む光学系が複雑化し非常に大きくなるという課題があった。また特許文献4に示されるようなロッドインテグレータは、その機能から光伝搬方向に対するインテグレータ自体の長さが大きくなるという課題があった。また特に、光源として干渉性の高いレーザ光源を用いた場合には、上記特許文献1から特許文献4で示された光量均一化デバイスから出射される光はスペックルノイズと呼ばれるレーザ光特有の微細な干渉パターンを有しており、例えば出射光を画像表示装置や照明装置などに使用するためには別途スペックルノイズ除去手段が必要となるという課題があった。

【課題を解決するための手段】

[0004]

上記課題を解決するため、本発明は、複数の導波管と、導波管を直列に光学的に結合する光路変換手段とを備え、導波管の任意の一端面に入射された光が導波管および光路変換手段を伝搬し、入射面と異なる出射面から出力されることを特徴とする光学素子である。また、上記光学素子と、半導体レーザとを備え、半導体レーザからの出射光を光学素子の一端面から入射させ、光学素子の別の端面から出射させることを特徴とするレーザ光源である。また、少なくとも上記のレーザ光源と、空間光変調手段とを備え、レーザ光源からの光を空間光変調手段に照明する照明光学系を有することを特徴とする2次元画像形成装置である。

【発明の効果】

[0005]

本発明において、非常にコンパクトな光学素子により、入射されたレーザ光を均一な断面光強度分布を有する出射光に変換できるという効果がある。また特に、中空構造のセルを導波管として用い、中空内部にブラウン粒子を混合した適当な気体または液体を封入することにより、干渉性の高いレーザ光源において発生するスペックルノイズを低減できる

という効果がある。また、上記光学素子と半導体レーザを一体化配置したレーザ光源により、光学素子からの出射光広がり角を制御した断面光強度均一化光源が実現できるという効果がある。また、上記レーザ光源と空間光変調手段からなる照明光学系により、簡単な部品構成でコンパクトな2次元画像形成装置が実現できるという効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】

[0006]

以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。

[0007]

(実施の形態1)

レーザ光源の研究・開発は目覚ましく、半導体レーザに代表される小型高出力レーザも実用化が進んでいる。出力波長は限定されるものの、半導体レーザでは例えばマルチモード半導体レーザで数Wクラスの出力を達成しているものもある。これまで、レーザ光源の用途は計測、光通信、光ディスク等、レーザ光の集光特性やコヒーレンスの高さを利用したものが主流であった。一方、レーザ光源の小型化・高出力化に伴い、アプリケーションの開拓や装置の開発も活発化してきており、画像表示装置、照明装置、半導体露光装置などへのレーザ光源の応用が期待されている。しかしながら、これらの用途においてはレーザ光の単色性と高出力特性を利用するのに加えて、さらに均一な断面強度分布を実現することが不可欠なものが多い。この要求を満たす手法として例えばレーザ光源からの出力光をコリメートし、ある程度の大きさに拡大した後、レンズやフィルターを組み合わせた光インテグレータやホモジナイザと呼ばれる光学素子や光学系を通してビーム成形し、ほぼ均一な光強度分布を得て利用していた。上記手法に用いる光学系は複雑かつ大規模になるため小型装置の実現が困難であるという課題があった。そこで我々は、本発明において小型の強度均一化レーザ光を達成する光学素子を提案し、その実用性を検証した。

[0008]

まず、本発明の光学素子において、入射光を断面強度分布が均一化な出射光に変換する ことが可能である点について説明する。図1には、複数の導波管と、導波管を直列に光学 的に結合する光路変換手段とを備えた光学素子の一例を示す。図1において、1a、1b 、1cはガラス材料からなる導波管、2aおよび2bは光路変換手段である直角プリズム である。なお、導波管1a、1b、1cへの光閉じこめを効率よく行うために、光の伝搬 方向端面以外の外周面には例えばA1材料からなる金属膜などの反射膜が形成されている ものとする。また、本実施の形態に示す光学素子においては、導波管laとlb、および 導波管1bと1cが接着等により光の伝搬方向と平行な各導波管側面で接着され、積層構 造をなしている。また、導波管1a、1b、1cを直列に光学的に結合するように直角プ リズム2aおよび2bが配置されている。以下、本構成における光学素子の機能について 説明する。導波管1aの一方の端面(直角プリズム2aに接続されていない側の端面)か ら入射された光は導波管1aおよび光路変換手段である直角プリズム2aを伝搬し導波管 1 b に入射される。同様にして導波管 1 b を伝搬した光は直角プリズム 2 b により導波管 1 c に光学的に結合され、最終的には導波管 1 c の端面(直角プリズム 2 b と接続されて いない側の端面)から出射される。ここで、例えば入射光にレーザ光を用いた場合を考え る。一般にレーザ光はガウシアン分布の断面光強度分布を持つが、上記構成により導波管 内を多重反射しながら伝搬していくと入射されたレーザ光強度が混合されることにより導 波管1a、1b、1cの任意の断面(光の伝搬方向と垂直な面)で見た光強度分布は光入 射端面から伝搬方向に遠ざかるに従い徐々に面内で均一化される。従って導波管1a、1 b、1 c の光伝搬方向長さを適当な値に設定することにより導波管 1 c の光出射端面に達 するまでに均一な断面光強度を得ることができる。ここで、例えばごく一般的な半導体レ ーザ(AIGaAs系やAIGaInP系、GaN系など)では、出射光のアスペクト比 および広がり角が異なる。従って、例えば断面アスペクト比がほぼ1となる導波管を用い た場合、広がり角の大きい方向に対して断面強度分布を均一化するために必要な導波距離 が短く、広がり角の小さい方向に対してはその距離を長くとる必要がある。これまでに、 同様の出力光断面強度分布均一化の方法として、例えば特許文献 4 に示されるようなロッ

ド状インテグレータ導波管を用いたデバイスが提案されているが、完全な均一化を行うために光の伝搬方向に対してロッド長を数10mm以上にする必要があった。本発明によれば、例えば本実施の形態では3つの導波管1a、1b、1cのトータルの光路長を設定して各導波管サイズを短くし、素子全体の長さを大幅に短くすることが可能である。なお、本実施の形態で示した光学素子は、導波管積層個数と各導波管長さを任意に決定することが容易であり素子サイズを任意に変化させることができるという利点を有している。

[0009]

なお、積層する導波管個数が偶数個であった場合、光学素子への入射光進行方向と光学素子からの出射光進行方向が逆向きとなり、また積層する導波管個数を奇数個とすることにより、光学素子への入射光進行方向と光学素子からの出射光進行方向を同一にすることができるため、出射光強度分布均一化素子を用いた装置設計の自由度が広がるという利点もあった。

[0010]

なお、本実施の形態では、光路変換手段として直角プリズム2a、2bを用いた場合に ついて説明したが、導波管の一部を加工することにより光路変換手段を形成する方法にお いても同様の出射光強度分布均一化素子が達成される。図2には本実施の形態の別の例と して、導波管の形状加工により光路変換手段を形成した光学素子の一例を示す。図2にお いて、3a、3b、3cは導波管、4a、4b、4c、4dは導波管3a、3b、3cの 一部を斜めに形状加工した傾斜部分である。なお、導波管3a、3b、3cへの光閉じこ めを効率よく行うために、光の伝搬方向端面以外の導波管外周面および傾斜部分4 a、4 b、4c、4dの各表面に例えばAl材料からなる金属膜などの高反射膜が形成されてい るものとする。また5a、5bはそれぞれ導波管3aと3b、および導波管3bと3cを 光学的に直列に結合するために上記高反射膜コートがなされていない領域である。なお、 図中の点線矢印は光学素子内の光の伝搬方向を表している。また、本実施の形態に示す光 学素子においては、導波管3aと3b、および導波管3bと3cが接着等により光の伝搬 方向と平行な各導波管側面で接着され、積層構造をなしている。以下、本構成における光 学素子の機能について説明する。導波管3aの一方の端面(傾斜部分4aでない側の端面) から入射された光は導波管3aおよび光路変換手段である傾斜部分4aおよび領域5a を伝搬し傾斜部分4bを介して導波管3bに入射される。同様にして導波管3bを伝搬し た光は傾斜部分4c、領域5b、傾斜部分4cにより導波管3cに伝搬し最終的には導波 管3cの端面(傾斜部分4dでない側の端面)から出射される。上記構成により導波管内 を多重反射しながら伝搬していくと入射されたレーザ光強度が混合されることにより導波 管3a、3b、3cの任意の断面(光の伝搬方向と垂直な面)で見た光強度分布は光入射 端面から伝搬方向に遠ざかるに連れて徐々に面内で均一化される。

[0011]

なお、本実施の形態の別の例として、本発明の光学素子構成する導波管を、例えば可視光領域で透明な材質からなる中空構造のセルにより形成し、上記セル内部に気体または液体のいずれかとブラウン粒子を封入することにより、レーザ光特有のスペックルノイズを容易に除去できる点について説明する。スペックルノイズとは、例えばレーザ光源を用いてスクリーンに画像投影を行うような場合に、レーザ光がスクリーンで散乱される際にスクリーン上の各部分からの散乱光同士が干渉することによって生じる微細なムラ状のノイズである。このスペックルノイズを除去する方法として、これまでにスクリーンを振動させる方法や、拡散板を透過させてレーザ光に時空間的にランダムな位相を与える方法がいという課題があり、また拡散板等を用いる方法では画像投影に用いられる光量が低下するといった課題があった。本発明の光学素子は、本実施の形態で示したように導波管といった課題があった。本発明の光学素子は、本実施の形態で示したように導波管といった課題があった。本発明の光学素子は、本実施の形態で示したように真波管といった課題があった。本発明の光学素子は、本実施の形態で示したように真波管を中空構造のセルにより形成し、上記セル内部に気体または液体のいずれかと、ブラウン粒子を封入することで上記課題を解決することが可能となる。以下に上記の中空セル構造からなる光学素子とその効果について説明する。上述したように

、スペックルノイズは干渉性の高いレーザ光を用いたときに生じるものであり、スクリー ン上での散乱光同士の干渉がその要因である。従って、光源からのレーザ光の位相を時間 的、空間的にランダムに乱すことによりスペックルノイズを平均化し低減することが可能 である。そこで、我々は本発明の光学素子において、導波管を中空のセル構造として、上 記セル中に位相を乱す作用を与える方法を検討した。上述したように、一般に知られてい る方法として、例えばスクリーンを振動させる方法や、拡散板を透過させてレーザ光に時 空間的にランダムな位相を与え、空間的・時間的なスペックルパターン変化を生じさせる ことにより、観察されるスペックルノイズを低減できる。我々は、気体あるいは液体中に あるブラウン粒子に注目し、同様の位相攪乱作用があることを見いだした。ブラウン粒子 は、ブラウン運動(溶媒となる気体または液体粒子が様々な方向から様々な速度で衝突す ることによる規則性のない乱雑な動き)をするような粒子を指し、運動の活発さはブラウ ン粒子の大きさ、温度および溶媒の粘度に依存する。温度が高くなれば、溶媒をなす分子 の熱運動は活発になる。従って温度の上昇により溶媒分子は激しく移動し、それに伴いブ ラウン粒子も動きが活発になる。溶媒分子が勢いよく衝突するためブラウン粒子が突き動 かされる量も大きくなる。従ってブラウン運動は温度が高いほど活発になるということが わかる。また、ブラウン粒子の大きさが大きくなると、質量も大きくなる。これにより溶 媒分子がブラウン粒子を突き動かす量は小さくなる。また、ブラウン粒子の表面積が広く なったことにより、一度に多くの粒溶媒分子が様々な方向から衝突し、それらの力が打ち 消しあうため、ブラウン粒子が受ける力は小さくなる。この2つの理由によりブラウン粒 子が大きいとブラウン運動が起きにくくなる。本実施の形態においては、ブラウン粒子と して、コロイド粒子であるラテックス粒子 (ポリスチレン標準粒子、粒径 1 μ m程度)用 いた。コロイドとは一般には 10^{-9} m $\sim 10^{-6}$ m程度の大きさの粒子が示す性質を指 し、コロイド粒子の分散媒質が固体であるゲル、分散媒質が液体であるゾル、分散媒質が 気体であるエアロゾルに分けられる。いずれのコロイドもブラウン運動を示すが、扱い易 さのため分散媒質が液体からなるゾルを用いるのが好ましい。スペックルノイズ低減のた めには、透過させる光を散乱させることのできる大きさを有するコロイド粒子が必要であ る。そこで、上述した 1 µ m程度の粒径のものを用いた。また特に、可視光領域において 本発明の光学素子を用いるには上記コロイド粒子は使用波長域で透明であることが好まし い。コロイド粒子の多くは可視光に対して不透明であるが、コロイド濃度を制御して希薄 なコロイド溶液等を用いることにより光透過率とスペックルノイズ低減効果とを調整する ことが可能である。上記ラテックス粒子を充填剤(溶媒)である水に分散させたラテック ス溶液をセル構造の導波管内に密封し、沈降平衡に達した状態でレーザ光を照射し、導波 管からの出射光をスクリーンに投影したときに観察されるスペックルノイズを比較した。 上述した出射光強度分布均一化作用に加えて、ブラウン運動を行うラテックス粒子により 導波管内を伝搬するレーザ光の位相が時間的・空間的に乱されて平均化され、例えばガラ ス材料により形成した中空でない導波管を用いた場合に比べてスペックルノイズが大幅に 低減された。なお、粒子径0.8 μ m程度のラテックス粒子を用いると、粒子が軽くなる ため粒子分布および粒子のブラウン運動は激しくなり、より効果的なスペックルノイズ低 減が実現された。また逆に、粒径の大きなラテックス粒子(粒径3μm程度)を用いた場 合には光の散乱が大きくなるが、ブラウン運動が緩やかになるためトータルとしてスペッ クルノイズ低減効果が弱い。しかしながら、ラテックス溶液の温度を60℃以上の高温に するとブラウン運動が激しくなり、スペックルノイズ低減を効果的に行うことができるこ とがわかっている。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

なお、これまで説明してきた光学素子の構成においては、導波管の光伝搬方向長さがデバイスの大きさを決定する主要因となるため、できるだけコンパクトな光学素子を実現する設計が必要となる。図3に単純なロッド状の導波管を伝搬する半導体レーザ光の伝搬光路を幾何光学的に示す。図3は出射光光強度均一化のために最も長い導波管長さが必要となる場合として、単一の半導体レーザと導波管を直接接触するように配置した場合の側断面図である。図3において、6は半導体レーザ、7は屈折率がnの透明材料からなる導波

管である。また、図中の θ 1 は導波管 7 内でのレーザ光の広がり角であり光強度分布の半 値全角で表される。またレーザ光広がり方向の導波管7の幅をW、レーザ光入射端面から 導波管7の出射端面までの長さ(=導波管の長さ)をLとする。図3において導波管7に 入射されたレーザ光は導波管7側面に達した光強度分布の一部が反射され、導波管7の出 射端面までの領域では導波管7の側壁で折り返して重ね合わされた光強度分布が観測され る。この状態を図4に模式的に示す。図4 (a) は導波管が存在しない場合の自由空間中 を伝搬するレーザ光の強度分布を、図4(b)は導波管の側壁で光強度分布が反射により 折り返されたときの光強度分布の重なり状態を、図4(c)は実際に重ね合わされたとき の光強度分布を示す。わかりやすさのため、図4 (a)から図4 (c)においては光の伝 搬方向の任意の断面D-D'、E-E'、およびF-F'での光強度分布の様子を示して いる。図4(a)から図4(c)において、8は半導体レーザ、9は屈折率がnの透明材 料からなる導波管である。また、図中の heta $_2$ は半導体レーザ 8 の広がり角度を、 heta $_3$ は屈 折率nの導波管9内でのレーザ光の広がり角を示す。図4(a)に示すように、自由空間 中を伝搬する半導体レーザ8からの出射光は伝搬とともに広がり角θ2で広がっていく。 このとき、例えば本実施の形態で示すような導波管がなかった場合には、光強度は空間的 な広がりは増大するがその強度分布は変化せず、ガウシアン分布型の強度分布を維持し続 ける。ところが、側壁で全反射させるような導波管 9 が存在する場合には、屈折率が n の 導波管 9内に入射されるレーザ光の広がり角 θ $_3$ は $2 \times s$ i n $^{-1}$ ((s i n (θ $_2$ / 2))/n)となる。ここで導波管9の幅をWとすると、入射した光ビームがW/(2×t an $(sin^{-1} (sin (\theta_2/2)/n))$ となる距離に達したときその光強度分 布の一部が導波管9側壁により反射され始める。その後、反射される光強度分布は徐々に 増大し、出射端面までの領域では導波管9の側壁がなかった場合の光強度分布を導波管9 の幅Wに相当する部分で折り返して重ね合わせた光強度分布が観測される。このとき、反 射により折り返された光強度分布と反射されていない光強度分布とが重ね合わせられた実 際の断面光強度(図4(c)に示される)が、十分均一になるには例えば導波管9の長さ を十分長く取り、全反射回数を多くする程良い。しかしながら、デバイス作製および使用 の観点からすると、できるだけコンパクトなレーザ光源であることが望ましい。我々の検 討においては、図3に示すように出射レーザ光の広がり角を θ 1 、レーザ光伝搬方向と垂 直な方向の導波管7の幅をW、レーザ光入射端面から導波管7の出射端面までの長さをL としたとき、少なくとも

 $L \ge W/t$ an $(sin^{-1} (sin (\theta_1/2)/n))$ の条件を満たしておれば、光強度分布が均一化されるということが判っている。これは 本実施の形態で図1あるいは図2に示した構造においても同様であり、光路変換手段を含 む光学素子内の全光路長をLとして考えると同様の関係が成り立つ。

[0013]

(実施の形態2)

実施の形態1において述べたように、複数の導波管と光路変換手段を用いた非常にコン パクトな光学素子により、入射レーザ光の断面光強度分布を均一化し出射することが可能 であることを示した。本実施の形態では、実施の形態1で示した光学素子と、半導体レー ザとを組み合わせて一体化したレーザ光源について説明する。現在、広く市販されている レーザ光源の中で、最も小型の汎用レーザ光源は半導体レーザであり様々な装置や民生用 製品に用いられている。上述したように、半導体レーザの小型高出力化が進んでおり、出 力波長は限定されるものの、例えばマルチモード半導体レーザで数Wクラスの出力を達成 しているものもある。こうした小型高出力レーザを用いて出力光強度均一化光源を達成す るためには、実施の形態1で述べた光学素子と、半導体レーザとを一体化した光源モジュ ールが有効である。図5には、半導体レーザと出射光強度均一化のための光学素子とを一 体化したレーザ光源の一例を示す。図5(a)および図5(b)において10は半導体レ ーザ、11a、11b、11cはガラス材料からなる導波管、12a、12bは光路変換 手段である直角プリズムである。なお、図5 (b)は図5 (a)を側面から見た図である 。なお、導波管11a、11b、11cへの光閉じこめを効率よく行うために、光の伝搬

方向端面以外の外周面には例えばAI材料からなる金属膜などの反射膜が形成されている ものとする。また、本実施の形態に示す光学素子においては、導波管11aと11b、お よび導波管11bと11cが接着等により光の伝搬方向と平行な各導波管側面で接着され 、積層構造をなしている。また、導波管11a、11b、11cを直列に光学的に結合す るように直角プリズム12aおよび12bが配置されている。以下、本構成における光学 素子の機能について説明する。半導体レーザ10から出射したレーザ光は、導波管11a の一方の端面(直角プリズム12aに接続されていない側の端面)から入射され、導波管 11 a および光路変換手段である直角プリズム 12 a を伝搬し導波管 11 b に伝搬する。 同様にして導波管11bを伝搬した光は直角プリズム12bにより導波管11cに結合さ れ最終的には導波管11cの端面(直角プリズム12bと接続されていない側の端面)か ら出射される。このとき、導波管内を多重反射しながら伝搬してい間に入射されたレーザ 光強度が混合されることにより導波管11a、11b、11cの任意の断面(光の伝搬方 向と垂直な面)で見た光強度分布は光入射端面から伝搬方向に遠ざかるに連れて徐々に面 内で均一化される。従って導波管11a、11b、11cの光伝搬方向長さを適当な値に 設定することにより導波管11cの光出射端面に達するまでに均一な断面光強度を得るこ とができる。このようにして光学素子と半導体レーザとが一体化された、出射光の断面光 強度が均一化されたレーザ光源が達成できる。

[0014]

なお、本実施の形態の別の例として、上記構成に加えて両凸レンズもしくは平凸レンズ を備え、半導体レーザと光学素子との光路内に配置することにより、光学素子からの出射 光ビーム広がり角を小さくすることができる点について説明する。例えばごく一般的な半 導体レーザ(AIGaAs系やAIGaInP系、GaN系など)では、その構造から楕 円状のビームが出射され、出射光の広がり角がビームの垂直方向と水平方向とで異なる。 代表的な半導体レーザの広がり角は狭い方(半導体レーザ出射端でのビーム形状の長軸方 向)で8~15°、広い方(半導体レーザ出射端でのビーム形状の短軸方向)では20~ 30°になる。従って、例えば本実施の形態で示す導波管と光路変換手段を用いた光学素 子の出射光広がり角も同様の大きさを持ち、出射光を利用することを考えると非常に扱い にくい光ビームであると言える。上記課題を解決するため、我々は図6に示すように、両 凸レンズもしくは平凸レンズを半導体レーザと光学素子との光路内に配置し、光学素子へ の入射光角度が半導体レーザの広がり角よりも小さくなるようにすることで、光学素子出 射光の広がり角を抑えることを検討した。図6には、上記の出射光広がり角抑制検討を行 ったレーザ光源モジュールの側面図を示す。図6において、13は半導体レーザ、14は 導波管と光路変換手段である直角プリズムとからなる光学素子、15は平凸レンズである 。また、図中のX、YおよびZは便宜上の方向を表す。また、 θ_4 は半導体レーザ出射光 のX方向広がり角、 θ 5 は平凸レンズを透過した後のレーザ光のX方向広がり角である。 以下、本構成における機能について述べる。半導体レーザ13からの出射光は平凸レンズ 15を透過することにより、X、およびY方向に縮小される。このとき、平凸レンズ15 の屈折率および曲率を選択することにより任意のビーム広がり角に変換することが可能で ある。従って、例えば $\theta_4=30$ °であった場合に、光学素子 14 に入射するレーザ光の 広がり角θ5 を10°以下にすることも可能である。これにより光学素子14内部で多重 全反射を繰り返して出てくる出射光のビームのX方向広がり角を θ 5 と同程度に縮小する ことができる。なお、平凸レンズ15はX方向、Y方向ともに同じ曲率であるため、光学 素子14に入射されるレーザ光広がり角はX方向、Y方向それぞれに対して同じ比率で縮 小される。また、光学素子 14 に対するレーザ光の入射広がり角である θ_2 の大きさと、 光学素子14の内部光路長とは、実施の形態1中の(式1)に示されるようにトレードオ フの関係にあり、θ 5 が小さくなるほど光学素子 1 4 の出射端面光強度分布を均一化する のに必要な長さが大きくなる。従って、本構成のレーザ光源の用途に応じて θ 5 を選択で きる。なお、上記効果は、平凸レンズ15の代わりに両凸レンズを用いた場合でも同様で ある。

[0015]

なお、本実施の形態の別の例として、シリンドリカルレンズを備え、半導体レーザと光 学素子との光路内に配置することにより、光学素子を構成する導波管および光路変換手段 の光路長を短くすることができ、また光学素子からの出射光において任意のアスペクトを 選択することができる点について説明する。上述したように、一般的な半導体レーザでは 、出射光のアスペクト比および広がり角が異なる。従って、広がり角の大きい方向に対し て断面強度分布を均一化するために必要な導波距離が短く、広がり角の小さい方向に対し てはその距離を長くとる必要がある。ここで例えば、凹面を有するシリンドリカルレンズ を半導体レーザと光学素子との光路内に配置することにより、光路変換手段を含む導波管 のトータル光路長を非常に短くして出射光の断面光強度分布を均一化することができる。 図7には、上記の光路長短縮および出射光アスペクト制御検討を行ったレーザ光源モジュ ールの側面図を示す。図7 (b) は図7 (b) の側面図である。図7 (a) および図7 (b) において16は半導体レーザ、17は導波管と光路変換手段である直角プリズムとか らなる光学素子、18は凹面を有するシリンドリカルレンズである。また、図中のX、Y およびZは便宜上の方向を表す。シリンドリカルレンズ18はX方向に対して凹となる面 を有している。以下。本構成における機能について説明する。半導体レーザ16から出射 されたレーザ光はシリンドリカルレンズ18によりX方向のみ拡大される。従って、半導 体レーザ16からの出射光が本来有している楕円形状の短軸側のみを拡大し、任意のビー ムアスペクト比(X方向とY方向のビーム広がりの比)を形成することができる。また、 凹面を有するシリンドリカルレンズ18によってビーム拡大をはかるため、光学素子への 入射光広がり角が大きくなるため、出射光断面強度分布均一化に必要な光学素子17の光 路長を短くすることができる。本効果を用いることにより、例えば導波管断面形状を任意 のアスペクトを有する矩形に設計した場合に、シリンドリカルレンズの曲率を選択して効 率よく短い光路長で出射光断面強度分布を均一化し、かつ任意の出射光アスペクトを有す るレーザ光源が達成できる。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

なお、上記の半導体レーザと光学素子の間にレンズを配置する構成の代わりに、光学素 子の光入射端面が曲率を持つように加工しても同様の効果が得られ、凸面、凹面、あるい は導波管入射端面の垂直方向と水平方向とで異なる曲率を有する形状に加工することによ り上述の効果を選択することが容易に可能である。

[0017]

(実施の形態3)

実施の形態 2 において、均一な出射光断面強度分布を有するレーザ光源の実現とその効 果について述べた。本実施の形態では、上記レーザ光源を用いた照明光学系および、上記 照明光学系を有する2次元画像形成装置について述べる。

[0018]

図8には、出射光断面強度分布を有するレーザ光源と空間光変調デバイスを用いた照明 光学系の一例を示す。図8において19は半導体レーザ、20は導波管と光路変換手段で ある直角プリズムとからなる光学素子、21はレンズ、22は空間光変調デバイスである 液晶パネル、23は光学素子20から出射されたレーザ光、24は液晶パネル22を透過 した後のレーザ光である。実施の形態1および実施の形態2で述べたように、半導体レー ザ19と光学素子20により断面光強度分布が一様なレーザ光源が形成されており、半導 体レーザ19から光学素子20に入射されたレーザ光は光学素子20を伝搬する間に断面 光強度分布が均一化され、レーザ光23となる。さらに光学素子20の出射端面の像は、 レンズ21により液晶パネル22上に拡大投影される。このとき、例えば光学素子20の 断面形状を液晶パネル22の形状と相似形にすることにより、レーザ光23の光量をほと んど損失することなく有効に液晶パネル22に照射することが可能となる。液晶パネル2 2に照射されたレーザ光23は、例えば液晶パネルに2次元画像信号を与えることにより 、入力された2次元画像信号に応じて変調されたレーザ光24に変調される。このような 照明光学系を用いることにより、例えば背面投射型ディスプレイや、ヘッドマウントディ スプレイのように、大小各種ディスプレイを実現することができる。

[0019]

なお、上記照明光学系からの出射光を、適当な投影光学系を用いて例えばスクリーンに拡大投影することも可能である。図9には、上記照明光学系の構成に加えて、投影レンズを用いた拡大投影2次元画像形成装置の一例を示す。図9において、25は断面光強度が均一化されたレーザ光源と空間光変調デバイスを含む照明光学系、26は投影レンズ、27は照明光学系25を透過したレーザ光である。上述したように、照明光学系25において空間光変調デバイスに均一光強度分布で照明されたレーザ光は、空間光変調デバイスに与えられた2次元画像信号に応じて変調されたレーザ光27となり、投影レンズ26によりスクリーン上に拡大投影される。本発明のレーザ光源を用いることにより、小型で高出力の断面光強度均一化レーザ光源が容易に達成されるため、小型で100インチサイズクラスの投影が可能なレーザプロジェクタの実現できる。

[0020]

なお、本実施の形態においては、単一の導波管からなる照明光学系について述べたが、 例えば半導体レーザの波長を、赤、青、緑の各色に対応する波長に選び、それぞれに同様 の構造からなるレーザ光源を用意することにより、フルカラーの2次元画像形成装置を実 現することができる。また、紫外光波長域の半導体レーザを用いることにより、高出力か つ均一照明が必要な半導体露光装置等への応用も可能である。

【産業上の利用可能性】

[0021]

本発明は、均一な強度分布を有するレーザ光を得るための光学素子、または半導体レーザと上記光学素子を一体化した断面光強度均一化レーザ光源であり、高出力照明やレーザアシスト加工などに適用可能である。また、テレビ受像機、映像プロジェクタなどの画像表示装置や、半導体露光装置などの画像形成装置にも適用可能である。

【図面の簡単な説明】

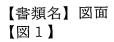
[0022]

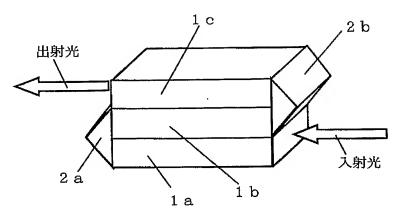
- 【図1】本発明実施の形態1における、複数の導波管と、導波管を直列に光学的に結合する光路変換手段とを備えた光学素子の一例を示す図
- 【図2】本発明実施の形態1における、導波管の形状加工により光路変換手段を形成した光学素子の一例を示す図
- 【図3】本発明実施の形態1における、単一の半導体レーザと導波管を用いた場合の、導波管内のレーザ光伝搬光路を幾何光学的に示した図
- 【図4】(a)は、本発明実施の形態1における、単一の半導体レーザが自由空間にある場合(導波管が存在しない場合)の、自由空間中を伝搬するレーザ光の強度分布の様子を示す図(b)は、本発明実施の形態1における、単一の半導体レーザと導波管を用いた場合の、導波管側壁による光強度分布の反射と、折り返して重ねられた光強度分布の様子を示す図(c)は、本発明実施の形態1における、単一の半導体レーザと導波管を用いた場合の、導波管側壁による光強度分布の反射により実際に重ね合わされたときの光強度分布を示す図
- 【図5】本発明実施の形態2における、半導体レーザと出射光強度均一化のための光 学素子とを一体化したレーザ光源の一例を示す図
- 【図 6 】本発明実施の形態 2 における、出射光広がり角を抑制するレーザ光源モジュールの一例を示す側面図
- 【図7】本発明実施の形態2における、光路長短縮および出射光アスペクトを制御するレーザ光源モジュールの側面図
- 【図8】本発明実施の形態3における、断面光強度分布が均一化されたレーザ光源と、空間光変調器とを有する照明光学系の一例を示す図
- 【図9】本発明実施の形態3における、断面光強度分布が均一化されたレーザ光源と、空間光変調器とを有する照明光学系に加え、投影光学系を備えた2次元画像形成装置の一例を示す図

【符号の説明】

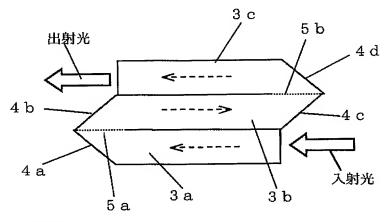
[0023]

- la, lb, lc, 3a, 3b, 3c, 7, 9, 11a, 11b, 11c 導波管
- 2 a, 2 b, 1 2 a, 1 2 b 光路変換手段
- 4 a, 4 b, 4 c, 4 d 傾斜部分
- 5 a, 5 b 領域
- 6, 8, 10, 13, 16, 19 半導体レーザ
- 14,17,20 光学素子
- 15 平凸レンズ
- 18 シリンドリカルレンズ
- 21 レンズ
- 22 液晶パネル
- 23,24,27 レーザ光
- 25 照明光学系
- 26 投影レンズ

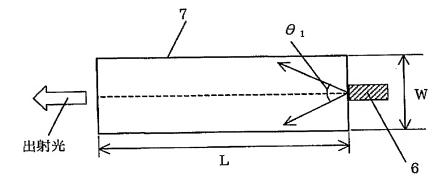


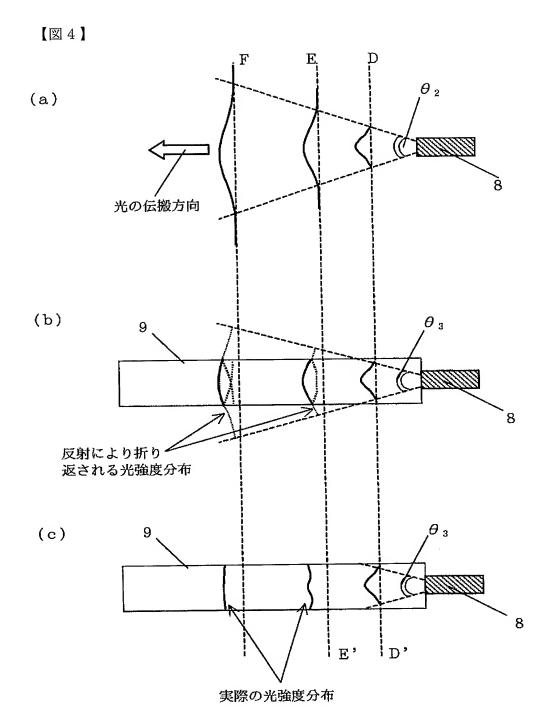


【図2】

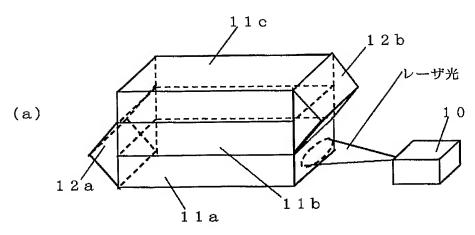


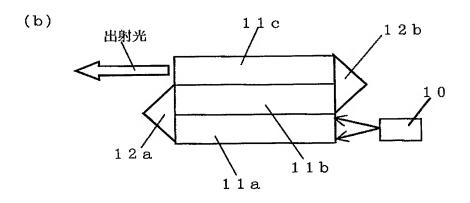
【図3】

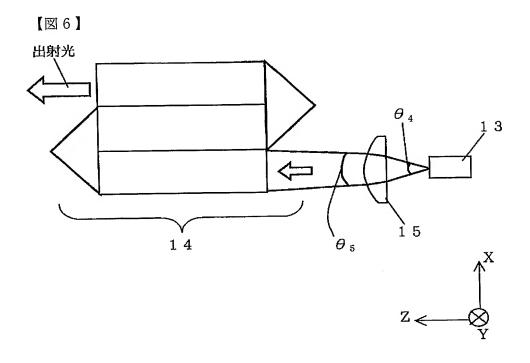




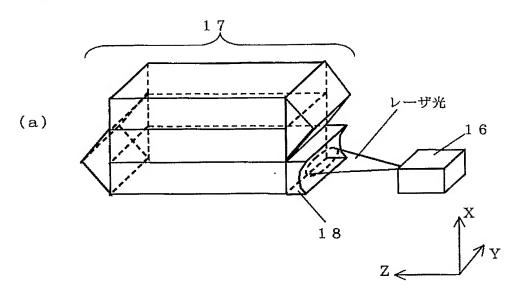


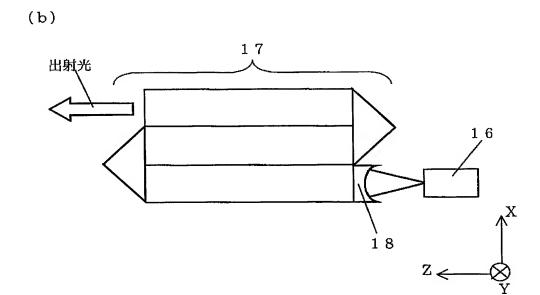


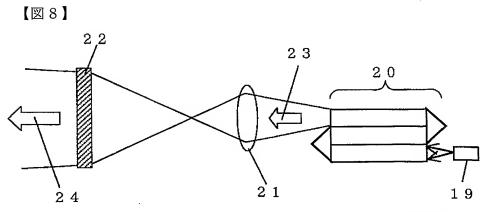




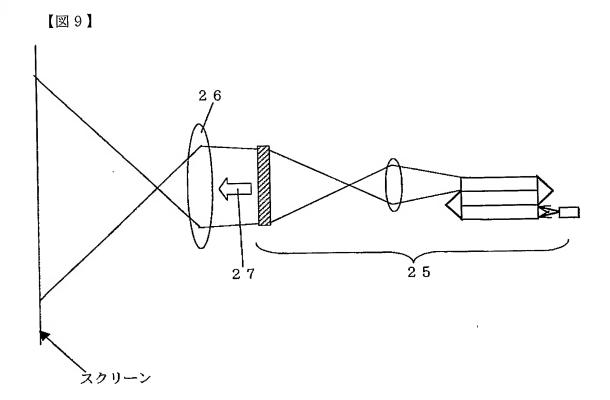








出証特2005-3003334





【要約】

【課題】コンパクトな光学素子により、入射光を、均一な断面光強度分布を有する出射光に変換することを目的とする。

【解決手段】複数の導波管と、導波管を直列に光学的に結合する光路変換手段とを備え、 導波管の任意の一端面に入射された光が導波管および光路変換手段を伝搬し、入射面と異 なる出射面から出力されることを特徴とする光学素子である。また、上記光学素子と、半 導体レーザとを備え、半導体レーザからの出射光を光学素子の一端面から入射させ、光学 素子の別の端面から出射させることを特徴とするレーザ光源である。また、少なくとも上 記のレーザ光源と、空間光変調手段とを備え、レーザ光源からの光を空間光変調手段に照 明する照明光学系を有することを特徴とする2次元画像形成装置である。

【選択図】図1

特願2003-411442

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

更理由] 新規登録 住 所 大阪府門

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社